

2018年4月4日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
東証第1部コード6920
代表者名 代表取締役社長 岡林 理
発表担当 経営企画室 室長 浅井 浩志

オン・セミコンダクターによる SICA88 購入のお知らせ

レーザーテック株式会社は、この度、オン・セミコンダクター (NASDAQ: ON) のシリコン・カーバイド・テクノロジー部門が当社の SiC ウェハ欠陥検査/レビュー装置 SICA88 を購入したことをお知らせいたします。オン・セミコンダクターはワイドバンドギャップ SiC ディスクリット、モジュール、ドライバーの世界的リーディング・サプライヤーです。本装置は、メイン州サウスポートランドにある同社の SiC デバイス工場に納入される予定です。

オン・セミコンダクター社の同部門のシニア・マテリアルズ&エピタキシー・マネジャーをつとめるリシケシュ・ダス氏は次のようにコメントしています。「オン・セミコンダクターでは、SiC 基板・エピタキシャル業界向け検査装置のリーディング・サプライヤーであるレーザーテックから購入した装置を使ってデータを収集し、当社の最先端 SiC デバイス技術の一層の向上を目指します。SICA88 には高い感度と分析能力、高スループットでの処理性能が備わっており、当社は SiC デバイスの品質と信頼性向上に活用する予定です。また、ディープラーニング・アルゴリズムを利用した On the fly 自動欠陥分類 (Automatic Defect Classification 略して ADC) 機能と高解像度レビュー画像を活用して、歩留り改善と採算性向上を実現したいと考えています。フォトルミネッセンスと明視野を組み合わせた SICA88 の検査を実施することで、プロセスフロー初期段階での正確な欠陥検出と分類、是正措置の導入が可能になり、その後の工程におけるデバイス不具合発生が減少することを期待しています。」

レーザーテックの関寛和技術一部長のコメント：SICA は SiC ファブの生産性を飛躍的に向上させるべく開発された装置です。本装置は、高感度・高スループットで欠陥検査を行うだけでなく、検査と並行して動作し、高解像度画像を用いて高精度にキラー欠陥を分類する ADC 機能、さらには全自動の欠陥レビュー機能を有しています。SICA の導入により、SiC 基板及びデバイスメーカーはより迅速な問題解決が図れるようになり、生産性や歩留りを飛躍的に向上させることができます。SICA のユーザーインターフェースは直感的な操作を可能とする GUI を採用しており、検査レシピ作成や自動レポート作成の操作性が向上しています。レーザーテックは、これからも欠陥検査技術の開発、向上に一層力を注ぎ、パワーデバイスの品質・生産性向上に貢献してまいります。

以上

◇製品お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社

第1ソリューションセールス部 アシスタントマネージャー 山村 英瑠

TEL : 045-478-7337 FAX : 045-478-7333 E-mail : sales@lasertec.co.jp